

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成26年4月3日(2014.4.3)

【公開番号】特開2012-169534(P2012-169534A)

【公開日】平成24年9月6日(2012.9.6)

【年通号数】公開・登録公報2012-035

【出願番号】特願2011-30909(P2011-30909)

【国際特許分類】

H 01 L 21/677 (2006.01)

H 01 L 21/31 (2006.01)

C 23 C 16/44 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/68 A

H 01 L 21/31 B

C 23 C 16/44 F

【手続補正書】

【提出日】平成26年2月13日(2014.2.13)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板処理装置本体と、

基板を搬送する搬送手段を備え、前記基板処理装置本体に基板を搬入出する搬入出部と、前記基板処理装置本体内において基板を移送する移送装置と、

前記搬入出部と前記移送装置とを離間させるようにして設けられ、前記基板処理装置本体内に搬入された基板を収納する収納部と、を有し、

前記搬送手段は、前記移送装置に向けて伸縮する伸縮部と、

前記伸縮部の伸縮動作に伴って、当該伸縮部の伸縮する長さよりも大きくなるように基板を移動させる移動部と、

を有する基板処理装置。

【請求項2】

前記搬送手段は、前記基板が収容される基板収容器を載置する載置部をさらに備え、前記載置部を前記基板処理装置本体外に位置する搬入出位置と、前記基板処理装置本体内に位置する受渡位置の間で搬送する請求項1に記載の基板処理装置。

【請求項3】

前記載置部が移動する長さは、前記伸縮部の延伸する長さの2倍となる請求項2に記載の基板処理装置。

【請求項4】

前記搬送手段は、前記伸縮部に接続される第1の移動部と、

前記第1の移動部の上部に設けられた第2の移動部とをさらに備え、

前記第2の移動部の移動する長さは前記第1の移動部の移動する長さの2倍となる請求項1から3に記載の基板処理装置。

【請求項5】

前記基板処理装置は、前記搬送装置を旋回自在とする旋回部をさらに備える請求項1から4に記載の基板処理装置。

【請求項 6】

伸縮部の伸縮する長さよりも大きくなるように基板を移動させ、基板処理装置本体に当該基板を搬入出する工程と、

前記基板処理装置本体内において基板を移送する工程と、

基板を搬入出する搬入出部と基板を移送する移送装置とを離間させるようにして設けられた収納部に基板を収納する工程と、

を有する半導体装置の製造方法。